

## Установка для нанесения покрытий NanoARC<sup>master</sup>950

### Применение

Установка NanoARC<sup>master</sup>950R предназначена для нанесения защитных и триботехнических покрытий, проведения исследований в области технологий ионного осаждения покрытий с использованием сбалансированных, разбалансированных и дуальных магнетронных распылительных систем, также вакуумно-дуговых испарителей с управляемой и неуправляемой дугой.

### Преимущества

Высокое качество покрытий. Позволяет увеличить стойкость к износу обрабатываемых поверхностей и, соответственно, продлить ресурс и срок их службы при разумных затратах на приобретение установки. Позволяет проводить исследования в области технологий ионного осаждения покрытий.

### Формы сотрудничества

Поставка готового типового продукта, разработка, производство и поставка продукта по требованиям заказчика.

Вакуумные покрытия получили широкое применение в различных отраслях жизнедеятельности, например: медицина (покрытия на титановые импланты), нефтегазохимия (различного рода запорная арматура), авиастроение (жаропрочное покрытие на лопатки турбин), кораблестроение (антикавитационное покрытие на винты), военная техника, приборостроение и др. В зависимости от требований к конкретному изделию и условий его эксплуатации мы можем наносить любое защитное покрытие.



### Основные параметры\*

Параметр	Значение	Примечание
Толщина наносимых покрытия, мкм	до 20	увеличение толщины - по согласованию
Твердость наносимых покрытий, Н/мм <sup>2</sup>	20000-38000	
Внутренние размеры камеры, Д×Ш×В, мм	950×950×600	Форма камеры-вертикальный восьмигранник
Количество мультикатодных вакуумно-дуговых испарителей, шт	2-4	
Количество торцевых вакуумно-дуговых источников в мультикатодном вакуумно-дуговом испарителе, шт	2	Вакуумно-дуговые испарители с управляемой и/или неуправляемой дугой
Суммарный ток мультикатодного испарителя, А	200-240	2×100-120
Размеры катода, Диаметр ×толщина, мм	130×26	
Количество магнетронов, шт	2-4	Разбалансированные магнитные системы
Размеры распыляемых мишеней, Д×Ш×В, мм	400×130×10	
Мощность источника питания магнетрона, кВт	12	Стабилизация по току, напряжению, мощности. Возможность работы в импульсном режиме
Ионный источник, тип	УЗДЭ (устройство с замкнутым дрейфом электронов, Радикал)	
Выходные рабочие характеристики источника питания ионного источника, В/А	2000/1	
Источник питания смещения, В/А	1200/10	
Мощность нагревателей, кВт	12	
Предельный вакуум, Па	$1,33 \times 10^{-3}$	
Скорость откачки до предельного вакуума, мин	30	
Количество каналов газонапуска, шт	3	
Управление/визуализация	Автоматическое	ЖК сенсорный монитор 19"
Установочная мощность, кВт	70	3ф ×380В+N, 50/60Гц
Расход горячей/холодной воды, л/мин	25/40	
Сжатый воздух, МПа	0,4-0,6	

\* Изготовитель может вносить корректировки в конструкцию оборудования не ухудшающие эксплуатационные и сервисные свойства.